

# プロセス部



ナノ・スピン実験施設クリーンルーム  
(Clean room in Laboratory for  
Nanoelectronics and Spintronics)

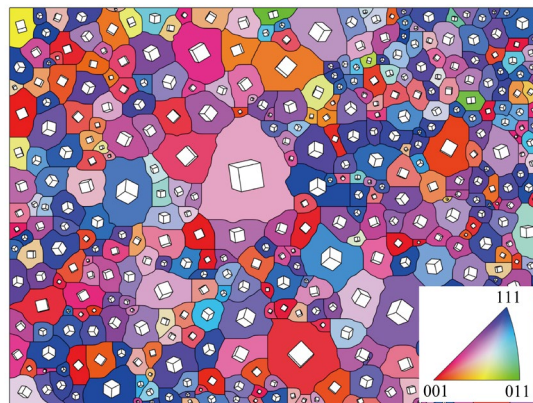


電子線描画装置  
(Electron beam lithography system)

# 評価部



X線回折装置  
(X-ray Diffractometer)



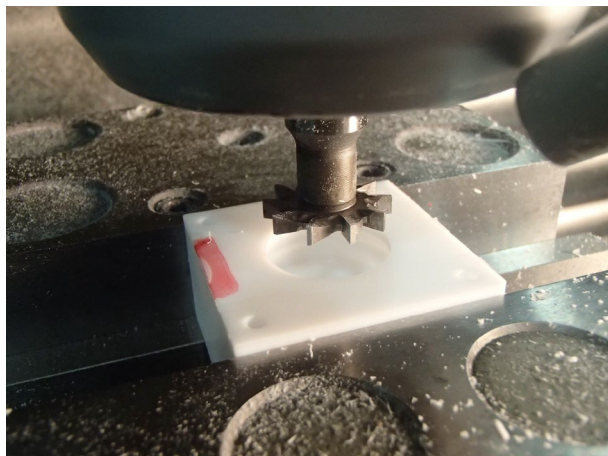
結晶方位の測定例  
(Example of Crystal  
Orientation Measurement)



走査型電子顕微鏡  
(Scanning Electron Microscope)



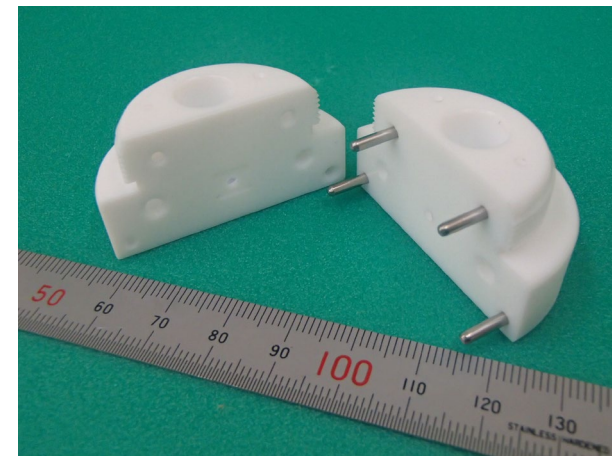
## 工作部



テフロン樹脂の切削加工  
(Teflon Resin Machining)



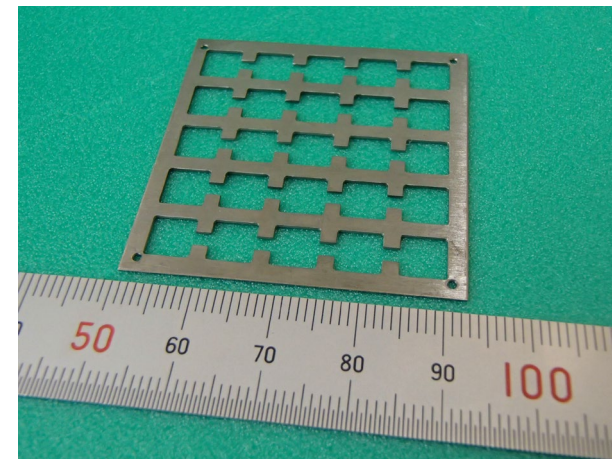
真空容器の加工  
(Vacuum Chamber Processing)



テフロン樹脂製容器  
(Teflon Resin Chamber)



附属工場内観  
(Interior View of Factory)



タンタル製サンプルホルダー  
(Tantalum Sample Holder)